

ポジレジスト(PFI-27C9)条件

スピコート条件

◆材料名:住友化学製 PFI-27C9

◆処理シーケンス

- ①HMDS塗布:約3cc(スポイド半分)、3000rpm、蓋閉じる
- ②プリウエット:OK73シンナー(TOK製)、500rpm ⇒ 別資料
- ③レジスト滴下:6sec(ウエハセンター)
- ④回転数:1000rpm、1400rpm、3000rpm ⇒ 膜厚データ別紙
- ⑤プリベーク:90°C、60sec(3000rpm) / 90sec(1400rpm、1000rpm)
⇒ メーカー推奨条件
- ⑥露光:別資料
- ⑦ポストイクスポージャーベーク(PEB):110°C、60sec / 90sec

回転数 vs 膜厚

PFI-27C9 レジスト膜厚

